Wzbudzanie i detekcja fal akustycznych



Detekcja infradźwięków







 R_m – rezystancja mechaniczna membrany C_m – podatność mechaniczna membrany M_m – masa mechaniczna membrany R_{mp} – rezystancja mechaniczna Z_m – impedancja mechaniczna l – głębokość obudowy

Obudowy i odgrody głośników



Im dłuższa fala tym skuteczniejsza interferencja destruktywna fal pochodzących od przeciwnych ścianek głośnika

stosowane środki zaradcze

- odgrodzenie membran
- odwracanie faz za pomocą prowadnic falowych

Różne typy obudów głośnikowych



Parametry głośnika

$F_{\rm s}$ - częstotliwość rezonansowa

VAS - objętość ekwiwalentna - objętość zastępcza obliczana na podstawie podatności zawieszenia i powierzchni membrany, dla głośników o średnicy 20 cm VAS = 40 .. 120

Efektywność - miara ciśnienia akustycznego w odległości jednego metra od głośnika

Efektywność mocowa - efektywność dla 1 W mocy dostarczanej do głośnika

Efektywność napięciowa - efektywność dla napięcia 2,83 V doprowadzonego do głośnika

Dla głośnika 8 Ω efektywności napięciowa i mocowa są równe, dla głośnika 4 Ω efektywność napięciowa jest większa o 3dB od efektywności mocowej.

Głośnik o mocy 100 W i efektywności 87 dB wytworzy takie samo natężenie dźwięku jak głośnik o mocy 50 W i efektywności 90 dB.

parametry Thiele'a - Smalla

 $Q_{\rm ts}$ - dobroć całkowita

 $Q_{\rm ms}$ - dobroć mechaniczna

$$\mathcal{Q}_{ts} = \frac{\mathcal{Q}_{ms}\mathcal{Q}_{es}}{\mathcal{Q}_{ms} + \mathcal{Q}_{es}}$$

 $Q_{\rm es}$ - dobroć elektryczna

 $S_{\rm d}$ - powierzchnia membrany

 B_l - siła która działa na cewkę głośnika

- B indukcja magnetyczna w szczelinie
- L indukcyjność cewki głośnika

 X_{max} - maksymalne liniowe wychylenie membrany

 $P_{\rm e}$ - moc znamionowa jaką głośnik może odbierać w sposób ciągły test DIN45-573 włączany na 1 min, wyłączany na okres 2 min test IEC 268-5 sygnał 100 godz. moc znamionowa zależy od normy, wg której była mierzona

 $R_{\rm e}$ - rezystancja cewki głośnika

 $M_{\rm ms}$ - masa całego układu drgającego





typ	KEC-1042PBL elektretowy		
kierunkowość	kwazi-izotropowy		
czułość	-42 ±3 dBA przy f=1kHz, 1Pa, 0 dBA=1V/Pa		
redukcja czułości	-3 dBA przy spadku napięcia zasilania o 0.5V		
S/N	58 dBA przy f=1KHz, 1Pa		
pasmo	20 Hz – 20 KHz		
impedancja wyjściowa	2.2 kΩ		
napięcie zasilania	2-10 V		
pobór prądu	$0.5 \text{ mA przy } 2 \text{ V i R}_{L}=2.2 \text{ k}\Omega$		
zakres temperatur pracy	-20 - +70 °C		
średnica	6 mm		
wysokość (bez wyprowadzeń)	1 mm		
masa	0,3 g		
obudowa	Al		

MEMS





dwukierunkowy (kwazi-dookólny) temp. pracy -40°C +100°C prąd zasilania 0,5 mA przy napięciu 2V pasmo 100Hz - 10 kHz poziom szumów 35 dB czułość -42 dBA zakres napięć zailania 1,5 – 5,5 V





Metody generacji i detekcji ultradźwięków



odwracalne - elektrostatyczne pojemnościowe piezoelektryczne elektrostrykcyjne

- elektromagnetyczne
- magnetoelektryczne
- magnetyczne
 piezomagnetyczne
 magnetostrykcyjne
 z indukcją prądów wirowych

Przetworniki piezoelektryczne i magnetostrykcyjne

Płytka piezoelektryczna pod wpływem pola elektrycznego ulega deformacji



podstawowe sposoby drgań płytek piezoelektrycznych (Kazis)





równanie ruchu dla płytki z cienkimi elektrodami ma postać:

$$\frac{m}{\alpha^2}\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{r}{\alpha^2}\frac{di}{dt} + \frac{k}{\alpha^2}i = U_0\omega\cos\omega t$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

prąd płynący przez płytkę

$$q = \alpha d_{11} U$$
 generowany ładunek , d_{ii} moduł piezoelektryczny odkształcenie

 $U = U_0 \sin \omega t$

 $\alpha = \frac{F}{U}$ współczynnik przekształcenia elektromechanicznego (transdukcji)

m, r, k - parametry płytki związane z masą, tłumieniem drgań oraz pojemnością elektryczną

Dla płytki piezoelektrycznej z cienkimi elektrodami metalowymi można podać następujący elektryczny schemat zastępczy:





 $\alpha \sim \frac{bl}{dd_{11}}$ $L = \frac{m}{\alpha^2}$ $R = \frac{r}{\alpha^2}$ $C = \frac{\alpha^2}{k}$

Ilościową miarą skuteczności przetwornika jest współczynnik sprzężenia elektromechanicznego

 $K = \frac{energia \ mechaniczna}{energia \ elektryczna}$

dla fal podłużnych

$$K^{l} = d_{11} \sqrt{\frac{C_{11}}{\varepsilon_0}}$$

 \mathcal{E}_0 – przenikalność elektryczna płytki nieruchomej

Przetworniki nie muszą mieć kształtu płytek





Bimorfy



Przemieszczenie końcówki bimorfu opisuje zależność

$$\Delta L \approx \frac{3}{4} \left(\frac{l}{g}\right)^2 d_{31} E$$

l – długość bimorfu, g – grubość jednego piezoelektryka, d_{31} – składową tensora podatności piezoelektrycznej (modułem piezoelektrycznym), E amplitudą pola elektrycznego

Generowana siła

$$F = \frac{2ga}{l} \frac{d_{31}}{\varepsilon_{11}^E} E$$

a – szerokość bimorfu

częstotliwość rezonansowa

$$f_0 \approx 0,161 \frac{2g}{l^2} \sqrt{\frac{1}{\rho \varepsilon_{11}^E}}$$





Formowanie wiązki 22





$$G(\theta, N, \theta o) := \frac{\sin \left[N \cdot \pi \cdot \frac{\delta \min}{\lambda} \cdot \left(\sin \left(\theta \cdot \frac{\pi}{180} \right) - \sin \left(\theta o \cdot \frac{\pi}{180} \right) \right) \right]^2}{N^2 \cdot \sin \left[\pi \cdot \frac{\delta \min}{\lambda} \cdot \left(\sin \left(\theta \cdot \frac{\pi}{180} \right) - \sin \left(\theta o \cdot \frac{\pi}{180} \right) \right) \right]^2}$$





szyki przetworników



Układy akustoelektroniczne z falą objętościową.











częstotliwość unormowana do modu podstawowego

Cienka płytka – drgania ścinające

Częstotliwość rezonansowa

$$f_n = \frac{n}{2h} \sqrt{\frac{C_{ij}}{\rho}}, \quad n = 1, 3, 5...$$

 f_n częstotliwość n-tego owertonu h grubość płytki rezonansowej ρ gęstość piezoelektryka C_{ij} tensor stałych sprężystych

Liniowy współczynnik temperaturowy

$$T_{f} = \frac{d\left(\log f_{n}\right)}{dT} = \frac{1}{f_{n}}\frac{df_{n}}{dT} = \frac{-1}{h}\frac{dh}{dT} - \frac{1}{2\rho}\frac{d\rho}{dT} + \frac{1}{2c_{ij}}\frac{dc_{ij}}{dT}$$



cięcie AT -10° do AT $+ 30^{\circ}$



 ^{34}T [°C]

materiał	cięcie	kierunek propagacji	prędkość fali Rayleigha [m/s]	współczynnik sprzężenia elektromech. [%]	współczynnik temperaturow y [10 ⁻⁶ /K]	względna przenikalność elektryczna
kwarc	42,75° Y (ST)	X	3175	0,16	0	4,5
kwarc	- 75° Y	X	3960	0,11	9	4,5
LiNbO3	Y	Z	3488	4,82	-94	36,7
LiNbO3	128° Y	X	4000	5,56	-74	39,1
LiNbO3	64° Y	X	4742	11,3	-79	37,1
LiTaO3	X	112° Y	3295	0,64	-18	44,0
LiTaO3	36° Y	X	4178	4,8	-33	48,3
Li ₂ B ₄ O ₇	45° X	Z	3401	1,0	0	9,6
polikryst. ZnO na szkle		-	2576	1,4	-11	10,8
kryst. ZnO na szafirze		-	5500	3,4	-7	10
Pb(Sn _{1/2} Sb _{1/2})O ₃ +PbTiO ₃ +PbZrO ₃		-	2420	2,4	-38	270
0,1Pb(Mn _{1/3} Nb _{2/3})O ₃ +0,9Pb(Zr _{0,74} Ti _{0,26})O ₃		-	2430	2,9	-17	460



$$\varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$\tau = RC \approx 10^{-14} \,\mathrm{s}$$

- nr owertonu n
- C_n C na n-tym owertonie

- ε przenikalność elektryczna

- r współczynnik pojemnościowy
 - częstotliwość rezonansu szeregowego
- częstotliwość antyrezonansu f_a

K współczynnik sprzężenia elektromech.

$$\frac{d\varphi}{df} \cong \frac{360}{\pi} \frac{Q}{f_s}$$

 $C_n \approx \frac{r'C_{11}}{r^3}$ $L_n \approx \frac{n^3 L_{11}}{r'^3}$ $R_n \approx \frac{n^3 R_{11}}{r'}$ $r' = \frac{f_1}{f}$ $2r = \left(\frac{\pi n}{2K}\right)^2$


Przeciąganie rezonatorów





Oscylatory stabilizowane kwarcowo

XO - Crystal Oscillator VCXO - Voltage Controlled Crystal Oscillator OCXO - Oven Controlled Crystal Oscillator TCXO - Temperature Compensated Crystal Oscillator TCVCXO - Temperature Compensated/Voltage Controlled Crystal Oscillator OCVCXO - Oven Controlled/Voltage Controlled Crystal Oscillator MCXO - Microcomputer Compensated Crystal Oscillator RbXO - Rubidium-Crystal Oscillator





Warunki oscylacji!

Układy podstawowe

Colpittsa



rezonansowy

Pierce'a

Hartleya





5..22p



układy na bramkach logicznych





Zgodnie ze standardem przyjętym przez amerykański Krajowy Instytut Normalizacji i Techniki (National Institute of Standards and Technology) jednostronny szum fazowy jest definiowany poprzez stosunek całkowitej gęstości mocy sygnału P_0 do gęstości mocy przypadającej na 1 Hz połowy pasma z dala od nośnej P_{1Hz} .



$$S_c(f_m) = \left(\frac{\Delta f}{2f_m}\right)^2 = \frac{1}{2}S_{\Phi}(f_m) \simeq \frac{S_{\Delta F}(f)}{2f_m^2}$$

Tak zdefiniowany szum można wyrazić też poprzez dewiację częstotliwości oraz częstotliwościową $S_{\Lambda F}(f_m)$ i fazową $S_{\Phi}(f_m)$ gęstość spektralną



A - szum swobodnego błądzenia (random walk frequency) powodowany czynnikami zewnętrznymi takimi jak zmiany temperatury, wibracje, zmiany wilgotności itp. B – szum migotania częstotliwości, (flicker frequency) pochodzący od rezonatora lub wzmacniacza C – szerokopasmowy częstotliwościowy szum biały (white frequency) zależny od dobroci rezonatora D – szum migotania fazy (flicker phase) pochodzący od wzmacniacza i elementów pętli sprzężenia E – szerokopasmowy szum biały (white phase) generowany w zasadzie przez wszystkie elementy układu.

Prawa strona łamanej $S_{\Phi}(f_m)$ opisywana jest często modelem Leesona

 $L(f_m) = 10\log(S_{\Phi}(f_m)/2)$

$$L(f_m) = 10\log\left\{\frac{FkTB}{2P}\left[\frac{1}{f_m^3}\frac{f_0^2f_{1/f}}{4Q_L^2} + \frac{1}{f_m^2}\frac{f_0^2}{Q_L^2} + \frac{f_{1/f}}{f_m} + 1\right]\right\}$$

- F współczynnik szumów elementu aktywnego
- k stała Boltzmanna
- T temperatura bezwzględna
- B pasmo rezonatora
- P średnia moc gromadzona w rezonatorze
- f_0 częstotliwość rezonansowa
- $f_{\rm m}$ dewiacja częstotliwości rezonansowej

 $f_{1/f}$ - dewiacja częstotliwości rozgraniczającą odcinki B i C krzywej $S_{\Phi}(f_m)$

 Q_L – całkowita dobroć rezonatora

Równoważny opis daje także zastosowanie pojęcia dyfuzji fazy w oscylatorze



Za pomocą dyfuzji fazy można wyrazić zarówno częstotliwościową jak i fazową gęstość spektralną, a także tzw. łamaną Leesona

$$L(f) = \frac{2D}{\omega^2 + D^2} \quad \text{dla } \omega \gg D \quad L(f) = \frac{2D}{\omega^2}$$

Warunek ten dla oscylatorów o dostatecznie wysokiej częstotliwości pracy i małych szumach fazowych jest zawsze spełniony.

Dla oscylatora pracującego z częstotliwością powyżej kilkudziesięciu MHz i charakteryzującego się szumami rzędu -120 dB/Hz dyfuzja fazy nie przekracza 6 Hz.

Pomiar stabilności oscylatorów

x(t) - $\rightarrow |\tau| \leftarrow$ y_M $y(t) = \frac{1}{y_1} \frac{1}{y_2} \frac{1}{y_3} \frac{1}{y_4}$ $y_i = \frac{x_{i+1} - x_i}{\tau}$

odchylenie standardowe

dewiacja Allana

 $\sigma_{OSy}(\tau) = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^{M} (y_i - y)^2}$

$$\sigma_{y}(1\tau) = \sqrt{\frac{1}{2(M-1)} \sum_{i=1}^{M-1} (y_{i+1} - y_{i})^{2}}$$

$$\sigma_{y}(m\tau) = \sqrt{\frac{1}{2(M-2m)m^{2}\tau^{2}}} \sum_{i=1}^{M-2m} \left(-x_{i+2m} + 2x_{i+m} - x_{i}\right)^{2}$$

 $x_{i+l} = x_i + \tau \sum_{j=i}^{l} y_j$

gdzie:



dewiacja Allana

Porównanie wybranych typów oscylatorów kwarcowych ze wzorcem wodorowym

typ oscylatora parametr	тсхо	OCXO	Wodorowy
$\sigma_{y}(\tau = 1s)$	10-9	10-12	10-12
$\sigma_{y}(\tau)_{min}$ (noise floor)	10-9	10-12	10-15
Δf po nagrzaniu	10-6	10-8	10-12
starzenie/rok	5 · 10-7	5 · 10 ⁻⁹	1 · 10 ⁻¹³

Filtry monolityczne





krawędzie pasma 27, 40 MHz dewiacja amplitudy w paśmie < 1 dB szerokość pasm prejściowych 3 MHz lub współczynnik prostokątności 0,8 min. odstęp od listków bocznych 40 dB lub maks. poziom listków bocznych maks. wariacja fazy 2° w paśmie 28-38 MHz

maks. opóźnienie grupowe 0,5 μs straty wtrąceniowe < 10 dB zakres temp. pracy -20°C +80°C









Najprostszym i najczęściej spotykanym układem jest układ dwubiegunowy. Częstotliwości rezonansowe obydwu rezonatorów są takie same jednak na skutek sprzężenia mechanicznego pojawiają się dwa rezonanse

$$f_{1,2} = f_S \sqrt{1 + \frac{C_S}{2C_0} \pm \sqrt{K^2 + \left(\frac{C_S}{2C_0}\right)^2}}$$

 $K = \frac{C_S}{c_K}$ wsp. sprzężenia mechanicznego

przy połączeniu symetrycznym
$$f_{SYM} = f_S \sqrt{1 - K}$$
 $f_{SYM} < f_S$

przy połączeniu asymetrycznym $f_{ASYM} = f_S \sqrt{1+K} \cong f_{SYM} (1+K) \quad f_{ASYM} > f_S$

odległość rodzaju pracy – def. $f_{ASYM} - f_{SYM} = f_{SYM} K$

połączenia wieloogniwowe



Filtry takie wnoszą do układu tłumienie rzędu 10 dB – konieczne dodatkowe stopnie wzmocnienia



blok p.cz. OR RADMOR 5102

Każdy filtr monolityczny jest pewną kombinacją mechanicznie sprzężonych układów rezonansowych. Jeśli płytki są łączone tylko elektrycznie powstają filtry typu dyskretnego tzw. filtry kwarcowe. Najprostszym ich wariantem jest pojedynczy rezonator.

PRZYKŁAD



Filtry wieloogniwowe - podstawowe ogniwa



Stosując kombinacje połączeń ogniw i półogniw z reaktancjami (przeciąganie) można tą techniką realizować filtry niemal o dowolnych charakterystykach – jednak zwykle są to filtry środkowoprzepustowe bądź środkowozaporowe choć realizacja filtrów dolno i górno przepustowych jest także możliwa.

Syntezę realizuje się dowolną z metod zwylke przy użyciu schematów zastępczych rezonatorów.



Projektowanie filtrów kwarcowych metodą transformacji prototypowego filtru dolnoprzepustowego



prototyp







 $C \equiv C =$

- C C

- = 0



Czybyszewa

-	<i>a</i> 1	a3	43	4	đş	a6	a 7	a	A9
3	1,3451	1,1412	1,3451		_	T	_	-	_
4	1,146	1,513	1,513	1,146			100	-	-
5	1,456	1,307	2,283	1,307	1,456	-	_		5
6	1,277	1,528	1,878	1,878	1,528	1,277	-		
7	1,488	1,343	2,388	1,451	2,388	1,343	1,488	_	-
8	1,340	1,508	2,019	1,844	1,844	2,019	1,508	1,340	1-1
9	1,502	1,357	2,420	1,481	2,480	1,481	2,420	1,357	1,502

Butterwortha

"	<i>a</i> 1	<i>a</i> ₁	<i>a</i> 3	<i>a</i> 4	45	<i>a</i> ₆	<i>a</i> 7	a,	ag
2	1,414	1,414		_		_	-1	-	4
3	1,000	2,000	1,000	-	-	-	-	-	-
4	0,7654	1,848	1,848	0,7654	-				-
5	0,6180	1,618	2,000	1,618	0,6180	-	-	-	1-2
6	0,5176	1,414	1,932	1,932	1,414	0,5176	-	- 1	
7	0,4450	1,247	1,802	2,000	1,802	1,247	0,4450	-	-
8	0,3902	1,111	1,663	1,962	1,962	1,663	1,111	0,3902	
9	0,3473	1,000	1,532	1,879	2,000	1,879	1,532	1,000	0,347





Wzbudzanie i detekcja akustycznych fal powierzchniowych

Historia

Pierre Curie, Jacques Curie	wyjaśnienie piezoelektryczności prostej	1880
Gabriel Jonas Lippmann	odkrycie piezoelektryczności odwrotnej	1881
Lord Rayleigh (John Strutt)	fale powierzchniowe	1885
Woldemar Voigt	"Lernbuch der Kristallphysik"	1910
Augustus Edward Hough Love	poprzeczne fale powierzchniowe	1911
Paul Langevin i wsp.	znakomity mozaikowy detektor łodzi podwodnych [50 kHz]	1917
Paul Langevin	pierwszy rezonator kwarcowy	1918
W. S. Mortley	przetworniki fal powierzchniowych - patent brytyjski	1963
J. H. Rowen	przetworniki fal powierzchniowych - patent amerykański	1963
R. M. White F. W. Voltmer	IDT	1965



PRZETWORNIKI MIĘDZYPALCZASTE (IDT – ang. interdigital transducers)



Ewolucja – przetwornik fal objętościowych => przetwornik fal powierzchniowych (IDT)


$V=\delta$ - Diraca

 $A(\omega) \approx \sum E_n e^{-j\omega x_n/v}$

 E_n amplitudy impulsów przyłożonych między elektrodami w miejscach x_n





 $S(\tau) = s_1(\tau) * s_2(\tau) \qquad H(\omega) = H_1(\omega)H_2(\omega)$

 $H(\omega) \sim \sum E_n e^{-j\omega x_n/\nu} w_m e^{j\omega x_m/\nu}$

n,m





W = const $W = Sinc(x)F_{OP}$ $W = Sinc(x)F_{OP}F_{w}$



Minimalne straty wnoszone w zależności od pasma względnego przetworników dopasowanych szeregową indukcyjnością do rezystancji 50 Ω dla trzech podłoży.









W celu poprawy parametrów stosuje się m. in.

- Specjalne ważenie
- Specjalne typy przetworników
- Ślepe elektrody
- Dzielenie elektrod
- Precyzyjne modelowanie i technologia
- Stosowanie niekonwencjonalnych podłoży
- Tłumienie szkodliwych odbić
- Stosowanie różnych typów AFP
- Sprzęgacze kierunkowe
- Ekranowanie przejścia bezpośredniego

Spotykane metody ważenia



ważenie pojemnościowe



łamanie elektrod



pochylanie elektrod



wycinanie elektrod elektrod

Metodą tą otrzymuje się filtry środkowoprzepustowe czarakteryzujące się

>tłumieniem poza pasmem nawet poniżej 80 dB
>kilkudecybelowym – kilkudziesięciu dB tłumieniem w paśmie
>minimalnych zafalowaniach grzbietu impulsu ~0.1%
>precyzją charakterystyki o współczynnikach prostokątności bliskich 1
>niewielkimi rozmiarami – malejącymi wraz z częstotliwością
>wysoką powtarzalnością parametrów

prostotą technologii

Dwa współpracujące IDT są w istocie filtrem. Zwykle tylko jeden z przetworników jest długi (wąskopasmowy) i decyduje o charakterystyce przenoszenia całości.



Admitancyjne własności jednego przetwornika można rozpatrzyć stosując przedstawiony już Schemat zastępczy



O parametrach C_T , B_i i G_i decyduje rodzaj podłoża, liczba par elektrod N oraz apertura W. (obliczenia inżynierskie)

 $C_T = W C_0 N$

 $G(f) = G_0 \frac{\sin(x(f))^2}{x(f)^2}$

$$G_0 = 8K^2 C_T f_0 N^2 \qquad x(f) = \pi \frac{f - f_0}{f_0} N$$

$$B(f) = G_0 \frac{\sin(2x(f)) - 2x(f)}{2x(f)^2}$$

Przykładowe przebiegi dla $C_T=0,5$ pF, $W=100\lambda$, N=18, $f_0=303$ MHz





Metody poprawy parametrów



wstawianie elektrod ślepych (dummy)



stosowanie sprzęgaczy kierunkowych



ekranowanie przejścia bezpośredniego i tłumienie szkodliwych odbić



dzielenie elektrod



Przetworniki jednokierunkowe jednofazowe (SPUDT)







amplituda fali postępującej $R_x = E[(1-r)-j \ 0,73 \ r].$

amplituda fali wstecznej $S_x = E[(1+r)-j 0,73 r],$

E – amplituda pola elektr. r – wsp. odbicia od krawędzi elektrody

Metoda ta zapewnia niemal zerowe tłumienie w paśmie przepustowym ale stosunkowo niewielkie w paśmie zaporowym.

Symulacja odbicia fali na elektrodzie









 $\Delta f/f_0$

350 MHz 128° XY LiNbO₃







Dupleksery antenowe







typowe parametry tłumienie w paśmie Tx 1,2 dB Rx 1,8 dB poza pasmem Tx 53 dB Rx 45 dB WFS Tx 1,6 Rx 1,7



filtr górnej częstotliwości











Zalety filtrów z AFP

- wysokie częstotliwości pracy (GHz)
- małe rozmiary malejące z częstotliwością
- możliwość niemal dowolnego kształtowania charakterystyk
- możliwość przenoszenia stosunkowo dużych mocy
- łatwość dopasowania do układu
- możliwość scalania
- duża swoboda konfiguracyjna banki filtrów
- prostota i wysoka powtarzalność technologii
- niska cena

Rezonatory

Budowa klasycznych rezonatorów opiera się na wykorzystaniu pełnego odbicia fali objętościowej od płaszczyzn ograniczających płytkę rezonansową. W przypadku fal powierzchniowych analogiczne odbicie od krawędzi podłoża prowadzi do znacznych strat wynikających z rozpraszania AFP do fal objętościowych.

Niemal pełne odbicie można uzyskać przez wykorzystanie efektu sprzężenia fali postępującej i wstecznej, propagujących się pod periodycznie nałożonymi elektrodami. Zjawisko to jest szkodliwe w przypadku przetworników międzypalczastych. Analogiczne odbicie fali otrzymuje się też przy propagacji AFP pod periodycznie zaburzoną powierzchnią.

Istnieje kilka metod realizacji periodycznych zaburzeń powierzchni:

- wykorzystaniu niejednorodności elektrycznej wprowadzanej przez elektrody,
- zastosowaniu periodycznych rowków na powierzchni podłoża,
- naruszeniu struktury podłoża przez dyfuzję lub implantację jonów,
- nałożeniu na powierzchnię "ciężkich" elektrod.

Najczęściej stosowane są struktury rowkowe, wykonywane przez trawienie (np. jonowe). Stosuje się rowki o głębokościach w granicach 0,01÷0,03 długości odbijanej fali powierzchniowej. Podstawowe konfiguracje

Rezonator jednoportowy



Rezonator dwuportowy



Podstawowe własności struktur odbijających można analizować wykorzystując metody układu zastępczego. Niezbędne parametry określane są zwykle empirycznie.



Schemat zastępczy struktury rowkowej

W strukturach rowkowych obserwowany jest efekt przesunięcia częstotliwości pracy struktury odbijającej w stronę niższych częstotliwości wraz ze wzrostem głębokości rowków oraz efekt odbicia drugiej harmonicznej fali. Efekty te uwzględnia się przez włączenie susceptancji *B* między ogniwa układu zastępczego.

Przesunięcie środkowej częstotliwości pracy struktury odbijającej, uwzględniane przez susceptancję *B* ma wartość :

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{1}{\pi} \frac{B}{Y_0}$$

Empiryczne parametry układu zastępczego można zapisać w postaci zależności :

$$\frac{Y'_0}{Y_0} = 1 - 0, 67 \frac{h}{\lambda} \qquad \text{dla LiNbO}_3(YZ),$$

$$\frac{Y'_0}{Y_0} = 1 - 0, 54 \frac{h}{\lambda} \qquad \text{dla SiO}_2(ST, X)$$

$$\frac{B}{Y_0} = -42 \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 \qquad \text{dla LiNbO}_3(YZ),$$

$$\frac{B}{Y_0} = -35 \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 \qquad \text{dla SiO}_2(ST, X)$$

Zależności te obowiązują dla 0,01 < $h/\lambda < 0,03$ oraz periodu $\lambda/2$

Dla dostatecznie długich struktur odbijających można przyjąć, że podobnie jak w przypadku nieskończonego układu elektrod, w obszarze struktury propagują się fale postępujące i wsteczne, poza obszarem struktury propagują się zaś fale padające i odbite. Biorąc pod uwagę amplitudy tych fal oraz nakładając warunek zachowania energii sumy fal propagujących się w poszczególnych kierunkach otrzymuje się współczynnik odbicia dla całej struktury odbijającej.



Dla dostatecznie długich struktur wsp. Odbicia wynosi 1 przy czym ze względu na zjawiska szkodliwe nie stosuje się struktur dłuższych niż kilkanaście λ^2/h .

Faza odbicia ma liniowy przebieg w pobliżu częstotliwości środkowej, co pozwala na wprowadzenie pojęcia ekwiwalentnego lustra (w analogii do rezonatora Fabry-Perota), w pewnej odległości od początku struktury.

Odległość ta wynika z warunku na zmianę fazy fali odbitej od "lustra" i wynosi:

$$L_{p} = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial (f/f_{o})} \lambda$$
Współczynnik odbicia można wyrazić zależnością

$$\Gamma(\omega) = \frac{\frac{i\chi}{\sigma(\omega)} \sinh(\sigma(\omega)L)}{\cosh(\sigma(\omega)L) + \frac{i\delta(\omega)}{\sigma(\omega)} \sinh(\sigma(\omega)L)}$$

$$\chi = \frac{h}{3\lambda_0^2} \qquad \delta(\omega) = \frac{\omega - \omega_0}{v} \qquad \sigma(\omega) = \sqrt{\chi^2 - \delta(\omega)^2}$$



Odległość ekwiwalentnego lustra od czoła struktury odbijającej w jawnej postaci wynosi

$$L_p = \frac{1}{4\chi\pi}$$

Dobroć wewnętrznarezonatora

$$Q = \frac{2\pi \left| \Gamma(\omega) \right| L_{ef}}{\lambda_0 \left[1 - \left| \Gamma(\omega) \right|^2 \right]}$$

 $L_{ef} = 2L_S + L_T$

 L_S odległość ekwiwalentnego lustra od krawędzi IDT L_T odległość krawędzi reflektora od krawędzi IDT



Uproszczony schemat zastępczy rezonatora dwuportowego (obowiązuje tylko w pobliżu f_0)





 $L_{1} = \frac{L_{ef} R_{1}}{4 |\Gamma(f_{0})| f_{0}} \frac{L_{ef}}{\lambda_{0}} \qquad \qquad R_{0} = \frac{1 - |\Gamma(f_{0})|}{2 |\Gamma(f_{0})|} R_{1}$

Zalety rezonatorów z AFP

- wysokie częstotliwości pracy (GHz)
- małe rozmiary malejące z częstotliwością
- wysokie dobroci całkowite (nawet ponad 20 000)
- dobra stabilność częstotliwości
- łatwość dopasowania do układu
- możliwość scalania
- duża swoboda konfiguracyjna
- prostota i wysoka powtarzalność technologii
- niska cena









Parametr	Sym.	Min.	Тур.	Max.	Jedn.
Częstotliwość środkowa	f _o	-	~196,6		MHz
Straty wtrąceniowe	A ₀		12,0	15,0	dB
Dobroć wewnętrzna	Q _U	15 000	20 000		1
Dobroć całkowita przy obciążeniu 50 Ω	QL	11 000	14 000		
Rezystancja szeregowa	R ₁		290	S. Stat	
Indukcyjność szeregowa	L ₁		4370		Н
Pojemność szeregowa	C ₁		0,15		fF
Pojemność równoległa	C ₀		3,1	3,2	pF
Faza przy f _o			180		stopnie
Odległość między IDT	d		4,0		mm
Temperatura pracy	T _o		20		°C
Częst. Wsp. Temp.	FTC		0,032		ppm/°C ²
Podłoże	Kwarc STX				

Przykłady aplikacji















Stosunek mocy sygnału do szumu na wyjściu wyniesie więc

$$SNR_{WY} = \frac{\left(Ns\right)^2}{N\sigma_n^2} = \frac{Ns^2}{\sigma_n^2}$$

 $SNR_{WE} = \frac{s^2}{\sigma_n^2}$

zaś na wejściu wynosił tylko

SNR polepszył się zatem N razy czyli
$$N = \frac{T_s}{\Delta t} = T_s \Delta f$$

Linię taką można wykorzystać zarówno do generacji sygnału z LMCz jak i jego odbioru.







szerokopasmowy









Istnieją dwa warianty konstrukcji takich przetworników odbiorczych.

- 1 elektrody położone są w punktach wzdłuż drogi propagacji akustycznych fal powierzchniowych odpowiadających kolejnym maksimom sygnału "chirp"
- 2 elektrody są położone w stałych odstępach, a ich długości dobierane są tak, aby uzyskać założoną odpowiedź impulsową.
 Zmiana długości elektrod pozwala na odpowiednie ważenie próbek, o różnych opóźnieniach, odpowiadających położeniu elektrod.

Filtry dyspersyjne stosowane są przede wszystkim w radiolokacji, gdyż pozwalają na rozwiązanie sprzeczności polegającej na tym iż dłuższy sygnał daje lepszą wykrywalność, a krótszy lepszą rozróżnialność. Sygnał "chirp" jest w stanie pogodzić te przeciwstawne wymagania. Realizując filtrację optymalną pozwala on na takie skomprymowanie sygnału o czasie trwania T i paśmie B, że po filtracji ma on postać impulsu o czasie trwania 1/B, znacznie krótszym od T











Konwolutory – układy realizujące splot analogowy

W filtrach z AFP sygnał wyjściowy jest splotem sygnału wejściowego i odpowiedzi impulsowej współpracujących IDT.

W przypadku filtrów odpowiedź ta jest stała – zależnie od geometrii. Konwolutory realizują taką samą funkcję, ale sygnał wyjściowy nie zależy tak silnie od geometrii, a zależy od sygnału odniesienia.

Konwolutory są podzespołami realizującymi analogowe obliczanie całki splotowej. Na wejście takiego układu podawane są dwa sygnały, które w postaci fali przemieszczają się przeciwbieżne i mieszają. Ich mnożenie zachodzi na słabych nieliniowościach podłoża, a całkowanie na długości, na której sygnały się pokrywają.

Można wyróżnić dwie płaszczyzny zastosowań konwolutorów:

- ✓ ultra szybkie przetwarzanie informacji szerokopasmowość oznacza tu dużą szybkość,
- ✓ detekcja i dekodowanie sygnałów w systemach szerokopasmowych. Szerokie pasma są wykorzystywane do poprawy poziomu ochrony informacji oraz zwiększenia ogólnego zysku przetwarzania. Konwolutor pełni w takim przypadku rolę programowalnego korelatora o mikrosekundowych czasach odpowiedzi.



tzw. splot zdegenerowany

fala biegnąca od pierwszego przetwornika $A_1\left(t-\frac{x}{v}\right)\exp\left|i\omega_1\left(t-\frac{x}{v}\right)\right|$

fala biegnąca od drugiego przetwornika $A_2 \left(t + \frac{x - x}{y} \right)$

 $A_{2}\left(t + \frac{x - L}{v}\right) \exp\left[i\omega_{2}\left(t - \frac{x - L}{v}\right)\right]$

Wytworzone pole elektryczne od wzajemnie oddziaływających fal wyniesie:

$$E = cA_1\left(t - \frac{x}{v}\right)A_2\left(t - \frac{x - L}{v}\right)\exp\left\{i\left(\omega_1 + \omega_2\right)t - \left(\omega_1 - \omega_2\right)\frac{x}{v}\right\}$$

Daje ono wyjściowe napięcie

$$U(t) = c \exp\left(2i\omega t\right) \int_{0}^{L} A_{1}\left(t - \frac{x}{v}\right) A_{2}\left(t + \frac{x - L}{v}\right) dx$$

stała c charakteryzuje oddziaływania nieliniowe w podłożu.

Stosując podstawienie $\tau = t - x/v$ i przechodząc z granicami całkowania do nieskończoności uzyskuje się postać zdegenerowanej całki splotowej:

$$V_0(2\omega) = M \exp(2i\omega t) \int_{-\infty}^{\infty} A_1(\tau) A_2(2t-\tau) d\tau$$

Po scałkowaniu uzyskuje się zależność napięcia na wyjściu konwolutora od gęstości mocy fal akusytcznych w postaci

$$V_0(2\omega) = \frac{M}{W} \sqrt{P_1 P_2}$$

M współczynnik określający siłę oddziaływań nieliniowych materiałuW szerokość elektrody splatającej

Siłę oddziaływań nieliniowych można zwiększyć stosując rozwiązania specjalne



Urządzenie może pracować z sygnałami o BT = 600 (50 MHz pasmo i 12 µs opóźnienie), $W = 5\lambda_0 = 0,11$ mm, $f_0 = 156$ MHz. Niesymetryczne sprzęgacze wielopaskowe składają się z 235 pasków i pozwalają na uzyskanie kompresji 15:1 dla pięciopalcowego przetwornika o aperturze 1.65 mm.







Procesory Fouriera

Są to układy pracujące w czasie rzeczywistym obliczające w sposób analogowy transformaty Fouriera sygnałów szerokopasmowych. Oferują one liczbę punktów transformacji większą niż 2¹⁰. W porównaniu z cyfrowymi procesorami, ich wersje analogowe z AFP pracują w czasie rzeczywistym, z dużo szerszym pasmem, z niższym poborem mocy i z dużo większą niezawodnością. Charakteryzują się miniaturowymi rozmiarami.

Wadą procesorów Fouriera z AFP jest niższa dokładność (~1%) oraz ograniczony szumem zakres dynamiczny (60 - 70 dB).

Z teorii filtrów wiadomo, że odpowiedź impulsowa filtru w dziedzinie czasu odpowiada jego charakterystyce częstotliwościowej:

 $h(t) \Leftrightarrow H(\omega)$

Jeżeli odpowiedź impulsowa filtru z AFP przyjmie postać:

$$h(t) = e^{j\mu t^2}$$

gdzie $\mu = B/T$ jest nachyleniem charakterystyki fazowej filtru z liniową modulacją częstotliwości (*B* - pasmo, *T* - czas trwania odpowiedzi impulsowej), to z twierdzenia o splocie otrzyma się wyrażenie na postać sygnału wyjściowego w postaci:

$$s_{wy}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_{we}(\tau) e^{j\mu(t-\tau)^2} d\tau = e^{j\mu t^2} \int_{-\infty}^{\infty} s_{we}(\tau) e^{j\mu\tau^2 - j2\mu t\tau} d\tau$$

Podobieństwo sygnału wyjściowego i transformacji Fouriera sygnału f(t)

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

można pokazać przez dokonanie podstawienia i odpowiednie rozpisanie na . Przy założeniu liniowości relacji czasowo częstotliwościowych można otrzymać:

$$F(\omega) = F(\mu t) = e^{-j\mu t^2} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-j\mu \tau^2} e^{j\mu \{t-\tau\}^2} d\tau$$

Sugeruje to, w celu uzyskania transformaty, konieczność wymnożenia wstępnego sygnału wejściowego f(t) z przebiegiem posiadającym LMC, następnie splecenia w filtrze z AFP oraz kolejnego wymnożenia z przebiegiem z LMC.



Procesor Fouriera powinien zawierać przynajmniej trzy podzespoły z AFP kształtujące nieliniową charakterystykę fazową.

Wejściowy sygnał f(t) jest mieszany w mieszaczu M1 z sygnałem z LMC o nachyleniu charakterystyki fazowej - μ . Sygnał $S_{wy}(\tau)$ jest komprymowany w filtrze dyspersyjnym o nachyleniu charakterystyki fazowej μ . Jeżeli sygnał analizowany f(t)zawiera składowe częstotliwości $f_1, f_2, f_3, ...$ to sygnał $S_{wy}(\tau)$ będzie zawierał serię sygnałów skomprymowanych typu sinc(x), których amplituda będzie proporcjonalna do transformaty Fouriera sygnału f(t). Sygnały skomprymowane, odpowiadające poszczególnym składowym częstotliwości, będą przesunięte względem siebie w czasie. Sygnał $S_{wy}(\tau)$ można wtedy zaobserwować na oscyloskopie, przy czym skala czasu będzie odpowiadała skali częstotliwości ($\omega = 2\mu$).



Stosowane linie dyspersyjne mają skończony czas trwania odpowiedzi impulsowej *T* oraz skończoną szerokość pasma *B*. Z tego powodu rozdzielczość częstotliwościowa takiego procesora będzie miała postać:

$$\Delta f_s = \frac{1}{\min(T_e, T_c)}$$

Optymalnym pasmem pracy układu jest zakres, w którym spełniony jest warunek:

$$T_e = \frac{T_c}{2}$$

 $T_e B_e = \frac{T_c B_c}{4}$

zatem:

Szerokość pasma procesora wynosi:

$$BW_s = \mu(T_c - T_e)$$

Dla warunków optymalnych uzyskuje się:

$$BW_s = \frac{B_c}{2}$$

Maksymalna liczba punktów transformacyjnych jest związana z iloczynem czaspasmo filtru splatającego i jest tym większa im większą wartość ma iloczyn BW_s . Architektury procesorów Fouriera mogą mieć inne konfiguracje, które na ogół złożone są z podukładów mnożących splatających i generujących sygnały z LMC. W zależności od wzajemnego połączenia tych bloków otrzymuje się następujące dwie architektury podstawowe:



M-C-M - mnożący – splatający – mnożący

Porównanie architektur

Maksymalny czas trwania sygnału Maksymalna szerokość pasma sygnału $B_2=B_0-B_1$ B_1 Obcięcie pasma transformaty wyjściowej dla $B_s>B_0-B_1$ $B_s>B_1$ Obcięcie czasu trwania sygnału wejściowego dla



C-M-C - splatający – mnożący – splatający

C-M-C M-C-M $T_1 T_2 = T_0 - T_1$ $T_{\rm s} > T_1$ $T_{\rm s} > T_0 - T_{1138}$ Konfiguracja C-M-C jest optymalnym ze względu na

- rozdzielczość częstotliwościową procesora
- pasmo robocze.

Wymagania stawiane wartościom iloczynu czasowo-częstotliwościowego układów splatających w tej architekturze są mniej ostre niż w architekturze M-C-M przy jednakowych stratach, tym samym stosunku S/N oraz zakresie dynamicznym obu konfiguracji procesora.

Wadą architektury C–M–C jest potrzeba stosowania trzech układów AFP. (w M-C-M tylko 2)

Za pomocą układów tego typu można realizować transformacje

- Hadamarda,
- Fresnela,
- -falkowa
- in.



Główne obszary zastosowań

sonolokacja na niewielkie odległości (do kilkudziesięciu metrów),

defektoskopia bardzo małych (mikromechanika) i bardzo dużych przedmiotów (kadłuby),

zdalna defektoskopii (np. pomiar parametrów wirujących elementów),

detekcja i zdalna detekcja wielkości nieelektrycznych (przemieszczeń, przyspieszeń, odkształceń, naprężeń, momentów, itd.),

detekcja gazów i mieszanin gazów (e-nosy, z-nosy),

jako składniki materiałów inteligentnych



ŚRODOWISKO FIZYCZNE





Nadajnik kodu zasilany naciśnięciem palca

szyby okienne podłogi amortyzatory samochodowe aktywne amortyzatory inteligentne opony meble (łóżka, fotele itp.) zabawki



Elektryczne buty



Szyk siedmiu mikrofonów do sonolokacji naziemnej oraz metoda nasłuchu. Parametry minimalne: zakres częstotliwości 7-500 Hz, stabilność amplitudy $0,1 \cdot f[\%]$, stabilność fazy $0,06 \cdot f[\circ]$, zakres dynamiczny 120 dB.




<figure>

Niedaleka przyszłość



Czujniki akustoelektroniczne

dodatnie sprzężenie zwrotne



 $G_{DPS} \ge 1$ $\sum \varphi_i = 2\pi n = n \, 360^\circ$











przeciętne rozmiary 10 x 10 mm czułość rzędu °/s "prędkość obrotowa" równa częstotliwości fali Rayleigha

Układy zdalnej identyfikacji

Aktywatory

Czujniki monitorujące przestrzeń mają wadę polegającą na konieczności elektrycznego dołączenia ich do urządzenia centralnego.

Układy z AFP pozwalają na pokonanie tej niedogodności.



Struktura układu nadawczo-odbiorczego



Wymagane parametry zakres częstotliwości 0,15 - 3 GHz pasmo 1- 36 MHz dynamika 85 dB moc wyjściowa 40 dBm rozdzielczość amplitudy \pm 5 dB rozdzielczość fazy \pm 1° współczynnik szumów 5 dB

Zasięg wynika z równania radarowego

$$r = \frac{1}{4\pi} \sqrt[4]{\frac{P_o G_i^2 G_e^2 \lambda^4}{k T_o BF S_N D}}$$

Dla dużych mocy nadajnika (rzędu 10 W) i częstotliwości rzędu 400 MHz można uzyskać zasięg ponad 1 km.

 P_0 moc nadajnika pytającego G_i wzmocnienie odbiornika G_e zysk anteny sensora D straty sensora kT_0 energia szumów anteny odbiorczej B pasmo systemu F współczynnik szumów systemu S/N stosunek sygnału do szumu



Przykłady zastosowań









Aktywatory

Zjawisko piezoelektryczne pozwala konwertować napięcie na ruch.



Stosy piezoelektryczne





n=L/d – liczba warstw ε_{33T} – przenikalność elektryczna przy stałym naprężeniu A – powierzchnia elektrod d – grubość warstwy

 $i_{sr} \approx fCU_{pp}$ $i_{max} \approx \pi fCU_{pp}$





 $P_{sr} \approx CU_{\max}U_{pp}f \qquad P_{\max} \approx \pi CU_{\max}U_{pp}f$

$$P_{JOULE'a} \approx \frac{\pi}{4} \tan \delta f C U_{pp}^2$$



Mode	Calculated Frequency	Measured Frequency
(m,n)	(KHz)	
(4,0)	14.88	14.55
(5.0)	22.48	22.37
(6,0)	31.45	31.34 3











Silniki napędzane bimorfami



















Silnik z falą Rayleigha









Najprostszy model

założenia:

- rozmiar kontaktów suwaka z podłożem jest dużo mniejszy niż długość fali Rayleigha
- deformacje fali Rayleigha spowodowane obciążeniem powierzchni przez suwak są niewielkie i nie wpływają na siebie

- deformacje są równomiernie rozłożone wzdłuż suwaka

W czasie jednego cyklu fali Rayleigha $-\frac{\pi}{2} \le \omega t \le \frac{\pi}{2}$ wibracje w kierunku normalnym do powierzchni można w uproszczeniu opisać wyrażeniem:

$$y = A_y \sin \omega t$$

Suwak będzie poddawany działaniu siły normalnej (docisk) $F_n = c_y A_y (\sin \omega t - \sin \varphi)$ na odcinku styku styku pomiędzy

$$\omega t = \varphi, \left(-\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2}\right), \quad a \qquad \omega t = \pi - \varphi$$

 c_v jest współczynnikiem zależnym od sztywności podłoża

Analogicznie wzdłuż powierzchni:

 $x = A_x \cos \omega t$ $F_w = c_x A_x \left(\cos \omega t - \cos \varphi \right)$

Siła działająca na suwak będzie proporcjonalna do deformacji wzdłuż powierzchni w punktach kontaktu, stąd:

$$F = c_x A_x \left[\cos \varphi - \cos \omega t - (\omega t - \varphi) \sin \frac{v}{A_y \omega} \right]$$

Zależność ta obowiązuje dla dostatecznie dużego współczynnika tarcia (suwak przesuwa się bez znaczącego poślizgu).

f = 10 MHz $F_{\text{docisku}} = 30 \text{ N}$ $F_{wy} = 3 \text{ N}$ $a = 1000 \text{ m/s}^2$ $podłoże 128Y \text{ LiNbO}_3 - 60 \times 15 \text{ mm}$ suwak krzemowy 4 × 4 mm









Mikropompy mikrodysze przepływomierze





Piezo-transformatory



Przekładnia zależy od częstotliwości i obciążenia








moduł zasilania świateł samochodowych



zasilacze sieciowe do urządzeń przenośnych









